



## 電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会 第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

会期:2018(平成30)年10月30日(火)~11月1日(木)

会場:札幌市民交流プラザ(札幌市中央区)

<http://www.sensorsymposium.org/>

本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術の発展を目標に、この分野の研究成果発表と学・協会を超えた情報交換の場として開催される、日本最大のシンポジウムです。会期中は日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催の「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」、応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催の「集積化 MEMS シンポジウム」、そして今年新たに、化学とマイクロ・ナノシステム学会主催の研究会が同時開催されます。またエレクトロニクス実装学会との連携セッションも開催されます。本シンポジウムの参加登録者は、これらの同時開催シンポジウム等にも参加できます。密な議論の場とするために、昨年に引き続き**一般投稿を基本的にポスター発表のみ**としました。また、各種行事・企画を予定しています。皆様の積極的な投稿とご参加をお待ちしております。

### ○ 論文募集分野 (詳細はホームページに掲載)

1. 設計・製作技術, 材料
2. マイクロナノシステム
3. センサ・アクチュエータシステム
4. フィジカルセンサ
5. ケミカルセンサ
6. バイオセンサ
7. バイオマイクロナノシステム
8. 企画セッション (エレクトロニクス実装学会連携)

この1年に国際会議で発表された研究成果を日本国内に情報発信する機会としてご活用いただくことも歓迎いたします。また、電気学会の研究会および総合研究会の発表論文に新規データ(未公開データを含む)を追加した上で投稿可能です。

### ○ 発表形式および使用言語

#### 発表形式: ポスター形式

(一般投稿についてはポスター発表のみとします。五十嵐賞, 奨励賞, 最優秀技術論文賞, 優秀技術論文賞候補者のみ口頭発表とします。)

#### 使用言語: 日本語または英語

### ○ 発表申込方法

発表概要(A4版2ページ, PDFフォーマット)を、ホームページから投稿してください。投稿された発表概要は論文委員会で審査し、採否を通知します。

発表申込締切 ~~5月28日(月)~~→6月1日(金) 正午

採否結果通知 7月20日(金) 予定

講演論文締切 8月17日(金) 正午

口頭発表通知 9月14日(金) 予定

### ○ 速報発表申込方法

ポスター発表のみ、速報発表申込も受け付けます。投稿された論文は論文委員会で審査され、採否を通知します。

速報申込締切 9月7日(金)

### ○ 表彰

発表概要, 講演論文および会期中の発表を審査し、五十嵐賞, 奨励賞, 最優秀技術論文賞, 優秀技術論文賞, 優秀ポスター発表賞の各賞を選定し、シンポジウム会場で表彰を行います。**各賞の選考対象となるためには、発表申込時点で電気学会の会員であること(申請中を含む)が必要です。あらかじめ、会員資格をご確認ください。**

### ○ 学生会員無料入会キャンペーン

発表申込もしくは参加申込と同時に電気学会に入会すると、初年度学生会員費が無料になります。

### ○ 参加申込

早期割引は10月12日(金)までです。

### ○ テクニカルツアー

シンポジウム前日10月29日(月)午後、テクニカルツアー(JR北海道苗穂工場, 鉄道技術館)を開催します。(無料, 定員制)

### ○ 研究者交流(え〜まっぷ)

ポスター会場を利用して、本シンポジウムに関連する研究者・研究グループを紹介するポスター展示を行います。

### ○ フォトコンテスト

「Future Technologies ~アートのようなマイクロ・ナノテクノロジー~」センサ・マイクロマシン, 微細加工等に詳しくない方が興味を持ちそうな写真を募集・表彰します。デバイス(成功, 失敗は問いません)やマイクロ・ナノを表現した写真をお待ちしております。

### ○ 技術展示

センサ, MEMS デバイス関係およびその応用システム製品, 設計ツール, 製造装置, 測定機器, 材料, 実装技術関係, 書籍などの展示を募集します。技術プレゼンテーションセッションもあります。

技術展示申込締切 9月28日(金)

### ○ 同時開催シンポジウム

■■■ 第9回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」 ■■■

<http://www.jsme.or.jp/mnm/>

■■■ 第10回「集積化 MEMS シンポジウム」 ■■■

<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>

■ 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第38回研究会 ■

<http://cheminas.chips.jp/>

主催 電気学会 センサ・マイクロマシン部門

協力 応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会

日本機械学会 マイクロ・ナノ工学部門

化学とマイクロ・ナノシステム学会

協賛 (依頼中含む) エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 計測自動制御学会, システム制御情報学会, 次世代センサ協議会, 精密工学会, センシング技術応用研究会, 電気化学会, 電子情報通信学会, 日本材料学会, 日本真空学会, 日本信頼性学会, 日本生体医工学会, 日本赤外線学会, 日本ロボット学会, ニューセラミックス懇話会, マイクロマシンセンター, レーザー学会, 電気学会関連技術委員会

### ○ 問合せ先

「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局  
株式会社セミコンダクタポータル

電話: 03-5733-4971, FAX: 03-5733-4973

E-mail: [sensorsympo\\_2018@semiconportal.com](mailto:sensorsympo_2018@semiconportal.com)